10/524470

524,190

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### . 1 CONTROL OF THE PROPERTY OF

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. März 2004 (04.03.2004)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/018973 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B23O 17/22, G01B 3/00

G01D 5/347,

(72) Erfinder; und(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BÖGE, Ludwig

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/006845

(22) Internationales Anmeldedatum: 27. Juni 2003 (27.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 36 381.1

8. August 2002 (08.08.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH [DE/DE]; Postfach 12 60, 83292 Traunreut (DE). [DE/DE]; Eduard-Mörike-Weg 1, 07751 Jenapriessnitz (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

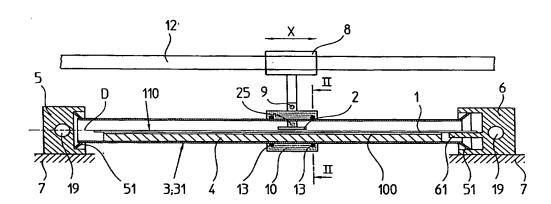
#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: LENGTH MEASURING DEVICE

(54) Bezeichnung: LÄNGENMESSEINRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to an encased length measuring device, the housing (3) of which forms a guide rail (31) for a directing carriage (10) that supports a scanning device (2). Said scanning device (2) is permanently fixed to the directing carriage (10) in all directions (X, Y, Z) while the directing carriage (10) is permanently attached to the machine part (8) that is to be measured. A misalignment relative to a machine-guiding member (12) during mounting of the housing (3) is corrected during measurement by means of coupling elements (51, 61) which are resilient perpendicular to the measuring direction (X) and are disposed between the housing (3) and the mounting elements (5, 6) or by using a flexibly slack housing (30).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine gekapselte Längenmesseinrichtung, deren Gehäuse (3) eine Führungsschiene (31) für einen die Abtasteinrichtung (2) tragenden Führungsschlitten (10) bildet. Die Abtasteinrichtung (2) ist in allen Richtungen X, Y, Z starr am Führungsschlitten (10) und dieser wiederum starr an dem zu messenden Maschinenteil (8) befestigt. Eine Fehlausrichtung beim Anbau des Gehäuses (3) gegenüber einer Maschinenführung (12) wird beim Messbetrieb durch senkrecht zur Messrichtung X nachgiebige Kupplungselemente (51, 61) zwischen dem Gehäuse (3) und den Montageelementen (5, 6) oder durch den Einsatz eines biegeschlaffen Gehäuses (30) korrigiert

10

20



#### Längenmesseinrichtung

-----

Die Erfindung betrifft eine Längenmesseinrichtung zur Messung der Relativlage eines ersten Maschinenteils gegenüber einem zweiten Maschinenteil. Das erste Maschinenteil ist beispielsweise das Bett einer Werkzeugmaschine und das zweite Maschinenteil der zum Bett verfahrbare Maschinenschlitten.

Zur genauen Positionsmessung an Werkzeug- oder Koordinatenmessmaschinen werden die Maßstäbe bzw. die Maßstabträger aufwendig parallel zur Messrichtung ausgerichtet befestigt, wobei die Messrichtung durch die Führung der Werkzeug- oder Messmaschine vorgegeben ist. Eine Maßnahme zur Ausrichtung ist beispielsweise in der DE 199 14 311 A1 und der DE 197 00 367 A1 beschrieben.

Diese Maßnahmen sind aber bei Längenmesseinrichtungen, bei denen der Maßstab in einem Gehäuse geschützt untergebracht ist nicht oder nur schwer anwendbar.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Längenmesseinrichtung anzugeben, bei der das Gehäuse mit dem darin angeordneten Maßstab einfach parallel zur Maschinenführung ausrichtbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Längenmesseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.

25 Vorteilhafte Ausführungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Die Erfindung wird anhand von Zeichnungen näher erläutert, dabei zeigt

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel einer Längenmesseinrichtung im Längsschnitt;



	Figur 2	einen Querschnitt II-II der Längenmesseinrichtung gemäß Figur 1;
5	Figur 3	einen Querschnitt der Längenmesseinrichtung mit einer Durchlicht-Abtastung;
	Figur 4	einen Querschnitt der Längenmesseinrichtung mit einer abgewandelten Linearführung;
10	Figur 5	eine Längenmesseinrichtung mit einem Schutz- band als Abdeckung;
·	Figur 6	eine Längenmesseinrichtung im Längsschnitt mit einer Abtasteinrichtung außerhalb des Gehäuses;
15	Figur 7	einen Querschnitt VII-VII der Längenmesseinrichtung gemäß Figur 6;
20	Figur 8	einen Querschnitt der Längenmesseinrichtung ge- mäß Figur 6 mit einem abgewandelten Gehäuse und
	Figur 9	eine Prinzipdarstellung mit einem biegeschlaffen Gehäuse.
25	Ashand der Eiguren 1	bis 5 werden gekanselte Längenmesseinrichtungen

Anhand der Figuren 1 bis 5 werden gekapselte Längenmesseinrichtungen beschrieben, bei denen ein Maßstab 1 sowie eine Abtasteinrichtung 2 ge-

schützt im Innenraum eines Gehäuses 3 angeordnet sind.

Die Längenmesseinrichtung gemäß den Figuren 1 und 2 besteht aus einem biegesteifen, eine kreiszylindrische Umfangsfläche aufweisenden Gehäuse 3, beispielsweise aus Aluminium, Kunststoff oder Stahl. An dem Gehäuse 3 ist über einen Träger 4 der Maßstab 1 befestigt.



Zur Positionsmessung ist das Gehäuse 3 über Montageelemente 5, 6 an einem ersten Maschinenteil 7 befestigt, dessen Position relativ zu einem zweiten Maschinenteil 8 gemessen werden soll. Die Ausbildung der Montageelemente 5, 6 wird später näher erläutert.

5

10

Zur Positionsmessung ist an dem zweiten Maschinenteil 8 über Befestigungsmittel 9 –insbesondere Schrauben- ein Führungsschlitten 10 befestigt, an dem wiederum die Abtasteinrichtung 2 zur Abtastung des Maßstabes 1 befestigt ist. Die Befestigung des Führungsschlittens 10 an dem zweiten Maschinenteil 8 erfolgt in Messrichtung X und in allen Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X starr.

Der Führungsschlitten 10 umgreift das Gehäuse 3 allseitig und die Umfangsfläche des Gehäuses 3 bildet eine Führungsschiene 31, an der der Führungsschlitten 10 spielfrei in Messrichtung X geführt ist. Der Führungsschlitten 10 ist über eine Kugelbuchse 11 an dem Gehäuse 3 in allen Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X spielfrei angekoppelt. Anstelle der Kugelbuchse 11 können auch andere Wälzführungen, oder auch Gleitführungen Verwendung finden.

20

15

An den beiden Enden des Führungsschlittens 10 sind Runddichtungen 13 zur Abdichtung zwischen dem Führungsschlitten und dem Gehäuse 3 angeordnet. Durch den Einsatz von umlaufenden Runddichtungen 13 ist eine gute Abdichtung gewährleistet.

25

30

Bei der Positionsmessung wird der Führungsschlitten 10 vom zweiten Maschinenteil 8 in Messrichtung X bewegt, wobei die Bewegungsbahn von der Maschinenführung 12, die in Figur 1 nur schematisch dargestellt ist, vorgegeben ist. Die in Messrichtung X und in allen Richtungen senkrecht dazu starre Ankopplung des Führungsschlittens 10 an dem zweiten Maschinenteil 12 sorgt dafür, dass eine fehlerfreie Übertragung dieser Bewegung auf die am Führungsschlitten 10 starr angekoppelte Abtasteinrichtung 2 gewährleistet ist. Die darüber hinaus in allen Richtungen senkrecht zur Messrichtung X spielfreie Führung des Führungsschlittens 10 am Gehäuse 3 sorgt

10

15

20

25

30

dafür, dass das Gehäuse 3 und somit der Maßstab 1 eine definierte Lage zur Maschinenführung 12 einnimmt. Das Gehäuse 3 muss somit nicht zwingend hochgenau parallel zur Maschinenführung 12 ausgerichtet angebaut sein. Bei einer Fehlausrichtung garantiert der Führungsschlitten 10 eine Mitnahme des Gehäuses 3 und somit eine korrekte Ausrichtung senkrecht zur Messrichtung X.

Um diese Ausrichtung im Messbetrieb zu gewährleisten, ist das biegesteife Gehäuse 3 mittels zumindest eines Montageelementes 5 am ersten Maschinenteil 7 befestigt, das Mittel 51 zur beweglichen Ankopplung des Gehäuses 3 in Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X aufweist. Diese Mittel können elastische Elemente 51 zwischen dem starr an das erste Maschinenteil 7 anschraubbare Montageelement 5 und dem Gehäuse 3 sein, wobei diese elastischen Elemente 51 gleichzeitig eine Abdichtung zwischen dem Gehäuse 3 und dem Montageelement 5 bilden können.

Das Montageelement 6 gewährleistet eine in Messrichtung X starre Ankopplung des Gehäuses 3 an das erste Maschinenteil 7, lässt aber Querbewegungen in allen Richtungen Y, Z zu. Das Montageelement 5 lässt ebenfalls Querabweichungen des Gehäuses 3 in allen Richtungen Y, Z zu, lässt aber auch einen Längenausgleich des Gehäuses 3 relativ zum Montageelement 5 zu. Das Montageelement 6 zur in Messrichtung X starren und senkrecht dazu auslenkbaren Befestigung des Gehäuses 3 enthält einen Federdraht 61 oder einen Stab, der Gelenke in Form von Schwachstellen aufweist.

Der Maßstab 1 ist ein Stahlband, das über eine Ölschicht 100 oder eine andere viskose oder elastische Zwischenschicht an dem Träger 4 haftend befestigt ist, wie in der DE 196 11 983 beschrieben. Es kann aber auch ein Glasmaßstab eingesetzt werden. Zur Bildung eines Fixpunktes ist der Maßstab 1 an einer Stelle in Messrichtung X starr am Gehäuse 3 und/oder an dem Montageelement 6 befestigt.

15

20

25



Die Montageelemente 5, 6 werden über Bohrungen 19 starr an das erste Maschinenteil 7 angeschraubt. Eine hochgenaue Ausrichtung zur Maschinenführung 12 ist dabei nicht zwingend erforderlich.

Zur hochgenauen Positionsmessung trägt der Maßstab 1 eine lichtelektrisch abtastbare Messstruktur 110, die zur Bildung von positionsabhängigen Abtastsignalen von einer Lichtquelle und einer lichtempfindlichen Detektoreinheit abgetastet wird.

Anstelle der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Auflicht-Abtastung mit einer reflektierenden Messstruktur 110 ist auch die Verwendung eines Maßstabs 200 möglich, der im Durchlicht-Abtastverfahren abtastbar ist, wie in Figur 3 dargestellt. Dabei ist der Maßstab 200 wiederum über einen Träger 4 oder unmittelbar am Gehäuse 3 befestigt und die Abtasteinrichtung 2 ist im Innenraum des Gehäuses 3 geschützt untergebracht. Die Abtasteinrichtung 2 weist auf einer Seite des Maßstabs 200 eine Lichtquelle 21 und auf der anderen Seite des Maßstabs 200 einen lichtempfindlichen Detektor 22 auf. Das Gehäuse 3 ist geschlitzt und dieser Schlitz 23 ist durch eine elastische Dichtung 24 abgedichtet, durch die ein schwertförmiger Mitnehmer 25 greift, der die Abtasteinrichtung 2 mit dem Führungsschlitten 10 in allen Richtungen X, Y, Z starr verbindet.

Die elastische Dichtung 24 kann durch ein Abdeckband 26 ersetzt werden. Dieses in Figur 5 dargestellte Abdeckband 26 ist im Schlitz 23 geführt, wobei es einerseits am Mitnehmer 25 befestigt ist und andererseits über Umlenkrollen 27, 28 am Gehäuse 3 gelagert ist, so dass es vom Mitnehmer 25 ausgehend über die erste Umlenkrolle 27 zur zweiten Umlenkrolle 28 zurück zum Mitnehmer 25 geführt ist und umläuft.

In Figur 4 ist eine abgewandelte Linearführung dargestellt. Die Führungsschiene wird wiederum von der Umfangsfläche 31 des Gehäuses 3 selbst gebildet, die Kugelbuchse ist hier aber durch eine Gleitführung ersetzt, wobei sich der Führungsschlitten 10 an mehreren Umfangsbereichen, insbe-

10

15

20

25



sondere aber an drei um 120° gegeneinander versetzten Umfangsbereichen des Gehäuses 3 abstützt und spielfrei geführt wird.

Figur 6 und 7 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Längenmesseinrichtung. Gegenüber den bisher erläuterten Beispielen befindet sich nun die Abtasteinrichtung 2 außerhalb des Gehäuses 3.

Das Gehäuse 2 ist rohrförmig und weist eine kreiszylindrischen Umfangsfläche 31 auf. Im Innenraum des Gehäuses 3 ist der lichtelektrisch abtastbare Maßstab 1 befestigt, der vorzugsweise ein längssteifes und gegebenenfalls an die Wölbung der Innenwand 32 angepasst vorgewölbtes Stahlband ist, welches über einen Ölfilm 100 direkt an der Innenwand 32 des Gehäuses 3 haftend befestigt ist. Die Messstruktur 110 des Maßstabs 1 wird von der Abtasteinrichtung 2 abgetastet, die über den Führungsschlitten 10 am zweiten Maschinenteil 8 in allen Richtungen X, Y, Z starr befestigt ist. Zur Abtastung durch das Gehäuse 3 ist dieses zumindest in dem Umfangsbereich A der Abtastung für das Abtastlichtbündel transparent. Das Gehäuse 3 kann also über den gesamten Umfang transparent ausgebildet sein, oder wie in Figur 8 dargestellt, nur partiell transparent sein, indem beispielsweise ein transparentes Segment 310 in ein Stahlsegment 320 eingesetzt ist.

Die Führung des Führungsschlittens 10 mit der Abtasteinrichtung 2 erfolgt am Außenumfang 31 des Gehäuses 3 oder an einer dem Gehäuse 3 starr zugeordneten separaten Führungsschiene in Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X starr.

Der Führungsschlitten 10 ist in Messrichtung X und in allen Richtungen senkrecht zur Messrichtung X starr an dem zweiten Maschinenteil 8 befestigbar.

30

Das Gehäuse 3, beispielsweise ein Glasrohr- insbesondere aus zähelastischem Glas- oder ein Kunststoffrohr, ist biegesteif ausgebildet und ist über die Montageelemente 5, 6 am ersten Maschinenteil 7 befestigt. Beide Montageelemente 5, 6 haltern das Gehäuse 3 senkrecht zur Messrichtung X

10

15

20

25

30



auslenkbar. Zur definierten Fixierung das Maßstabs 1 am ersten Maschinenteil 7 ist dieser an einem Montageelement 6 in Messrichtung X starr befestigt, wozu wieder ein Federdraht 61 oder ein Stab mit einem, aber insbesondere mit in Messrichtung X voneinander beabstandeten Gelenken in Form von Schwachstellen dient.

Um eine Fehlausrichtung zwischen der Maschinenführung 12 und dem Maßstab 1 im Messbetrieb auszugleichen, ist gemäß der Erfindung auch eine weitere Maßnahme vorteilhaft. Die Kupplungsmittel 51, 61 zwischen dem biegesteifen Gehäuse 3 und den Montageelementen 5, 6 werden dabei vom Gehäuse 30 selbst gebildet, indem dieses biegeschlaff ausgeführt ist. Diese Ausführung ist in Figur 9 im Prinzip dargestellt.

Die Führungsschiene wird wiederum von der Außenfläche 31 des Gehäuses 30 selbst gebildet. Alternativ kann eine eigene biegeschlaffe Führungsschiene dem Gehäuse 30 starr zugeordnet sein. Der Führungsschlitten 10 ist wiederum an der Führungsschiene 31 in Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X spielfrei angekoppelt. Vorteilhafterweise hat das Gehäuse 30 eine kreiszylindrische Umfangsfläche 31, welche der Führungsschlitten 10 allseitig umgreift und die Umfangsfläche als Führungsfläche 31 dient. Der Führungsschlitten 10 ist an der Führungsschiene 31 in Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X spielfrei angekoppelt. Die Abtasteinrichtung 2 ist starr am Führungsschlitten 10 und dieser wiederum in allen Richtungen X, Y, Z starr am zweiten Maschinenteil 8 befestigt. Durch das biegeschlaffe Gehäuse 20, das beispielsweise aus Kunststoff bestehen kann, ist sichergestellt, dass es im Messbetrieb zumindest im Führungsbereich und somit im Abtastbereich senkrecht zur Messrichtung X auslenkbar ist, so dass bei einer Bewegung des Führungsschlittens 10 senkrecht zur Messrichtung X das Gehäuse 30 in dieser Richtung mitgenommen wird. Eines der Gehäuseenden kann am ersten Maschinenteil 7 über ein Montageelement 6 starr und das andere Ende über ein weiteres Montageelement 5 längsbeweglich am ersten Maschinenteil 7 befestigt sein.



Die zu den Figuren 1 bis 8 erläuterten Maßstabanordnungen, Abtastprinzipien und Führungsausgestaltungen können auch bei dem Beispiel gemäß Figur 9 Verwendung finden.

Bei allen Beispielen ist möglich, dass der Führungsschlitten 10 um die Längsachse D des Gehäuses 3, 30 an der Führungsschiene 31 drehbar gelagert ist. Alternativ kann dieser rotatorische Freiheitsgrad geschaffen werden, indem das Gehäuse 3, 30 in den Montageelementen 5, 6 um diese Längsachse D drehbar gelagert ist.

10

20

25

30

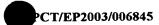
### Patentansprüche

=========

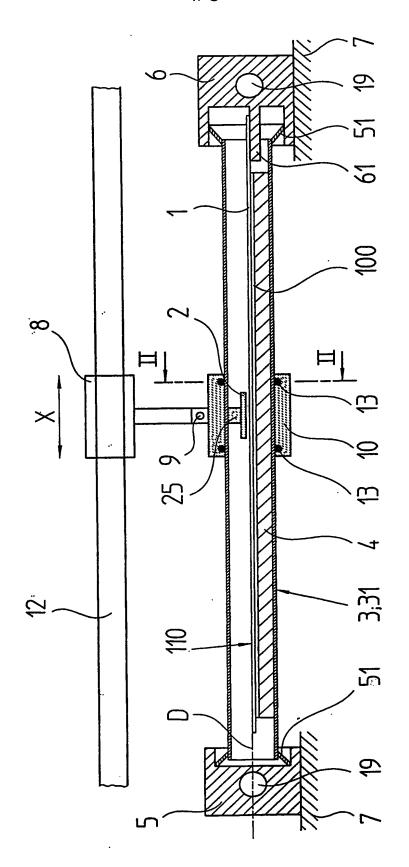
- Längenmesseinrichtung zur Messung der Relativlage eines ersten Maschinenteils (7) gegenüber einem zweiten Maschinenteil (8) mit
  - einem Gehäuse (3, 30), das am ersten Maschinenteil (7) befestigbar ist:
- einem Maßstab (1, 200) innerhalb des Gehäuses (3, 30), wobei der Maßstab (1, 200) entlang des Gehäuses (3, 30) in Messrichtung X verlaufend befestigt ist;
  - einer Abtasteinrichtung (2) zur Abtastung des Maßstabs (1, 200);
- einer Linearführung mit einer Führungsschiene (31), die dem Gehäuse (3, 30) starr zugeordnet ist und mit einem die Abtasteinrichtung (2) tragenden Führungsschlitten (10), welcher an der Führungsschiene (31) entlang des Gehäuses (3, 30) in Messrichtung X geführt ist, wobei
  - der Führungsschlitten (10) an der Führungsschiene (31) in allen Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X spielfrei angekoppelt ist;
  - das Gehäuse (3, 30) derart ausgebildet und am ersten Maschinenteil (7) befestigbar ist, dass es im Messbetrieb zumindest im Führungsbereich senkrecht zur Messrichtung X auslenkbar ist, so dass bei einer Bewegung des Führungsschlittens (10) senkrecht zur Messrichtung X das Gehäuse (3, 30) in dieser Richtung mitgenommen wird und
  - der Führungsschlitten (10) Befestigungsmittel (9) aufweist, mit denen er in Messrichtung X und in allen Richtungen Y, Z senkrecht zur Messrichtung X starr an dem zweiten Maschinenteil (8) befestigbar ist.
  - Längenmesseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsschiene von einer Außenfläche (31) des Gehäuses (3, 30) gebildet wird.



- 3. Längenmesseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (3, 30) rohrförmig ist und eine kreiszylindrische Umfangsfläche als Führungsfläche (31) der Führungsschiene aufweist, wobei der Führungsschlitten (10) an der Führungsfläche (31) mit einem Bewegungsfreiheitsgrad in Messrichtung X sowie mit einem rotatorischen Freiheitsgrad um die Längsachse D des Gehäuses (3, 30) spielfrei geführt ist.
- Längenmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, dass die Abtasteinrichtung (2) mit dem Führungsschlitten (10) in Messrichtung X und in allen Richtungen Y, Z senkrecht dazu starr verbunden ist.
- Längenmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Maßstab (1, 200) eine lichtelektrisch abtastbare Messstruktur (110) und die Abtasteinrichtung (2) zumindest eine Lichtquelle (21) und einen lichtempfindlichen Detektor (22) aufweist.
- Längenmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Maßstab (1, 200) innerhalb des Gehäuses (3, 30) angeordnet ist und die Abtasteinrichtung (2) zumindest eine Lichtquelle (21) und einen lichtempfindlichen Detektor (22) außerhalb des Gehäuses (3, 30) zur Abtastung des Maßstabs (1) mittels eines Lichtbündels durch das Gehäuse (3, 30) aufweist, wozu das Gehäuse (3, 30) zumindest in dem Umfangsbereich (A) der Abtastung für das Abtastlichtbündel transparent ist.
- Längenmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, dass der Maßstab (1) an einer Innenwand (32)
   entlang des Gehäuses (3) befestigt ist.
  - Längenmesseinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Maßstab ein längssteifes und biegeschlaffes Stahlband (1) ist.



- Längenmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (3) längssteif und biegesteif ist.
- 10. Längenmesseinrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (3) zumindest ein Montageelement (5, 6) mit einem Kupplungselement (51, 61) aufweist, mit dem es senkrecht zur Messrichtung X auslenkbar am ersten Maschinenteil (7) befestigbar ist.
- 11. Längenmesseinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungselement (51) an einem Ende des Gehäuses (3) das Gehäuse (3) längsbeweglich mit dem Montageelement (5) koppelt und das Kupplungselement (61) am anderen Ende des Gehäuses (3) das Gehäuse (3) in Messrichtung X steif mit dem Montageelement (6) koppelt.
  - 12. Längenmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (30) längssteif und biegeschlaff ist.



년 일

FIG. 2

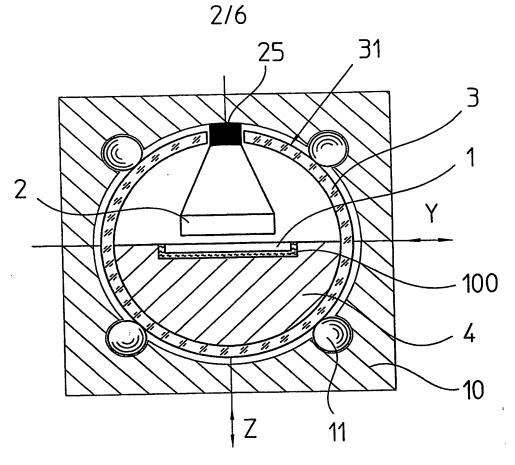


FIG. 3

25 24 23

11 31 3 21 21 200 4

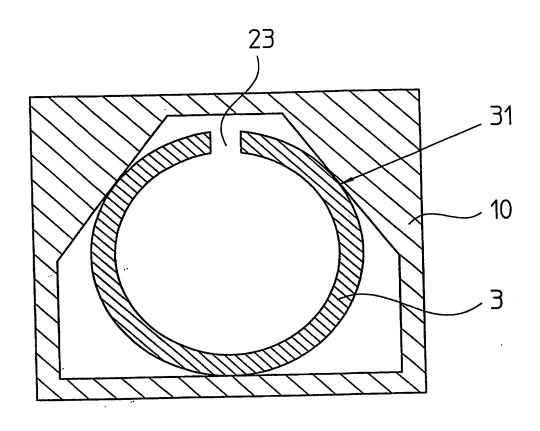
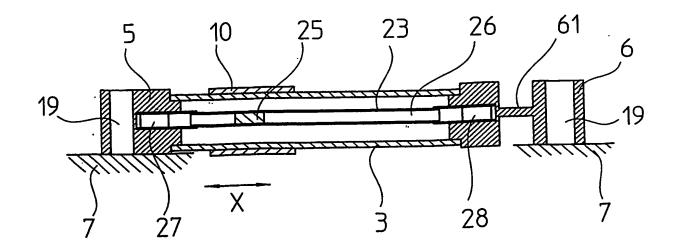


FIG. 5



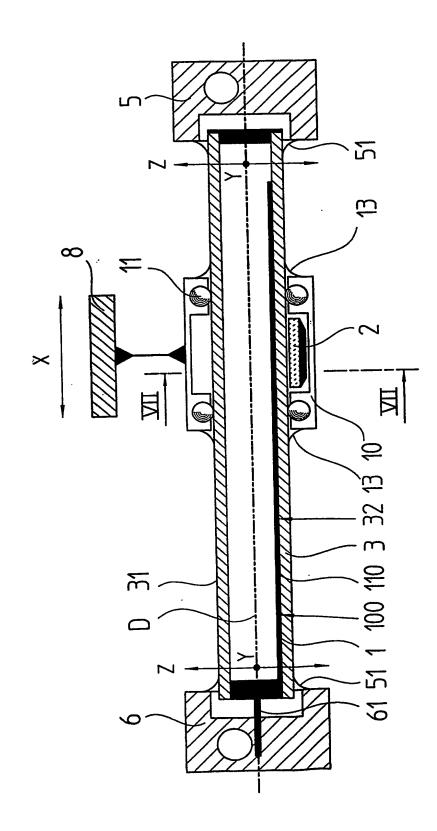


FIG. 7

5/6

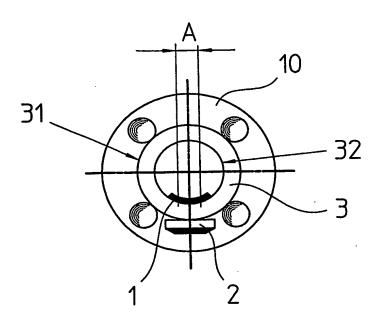
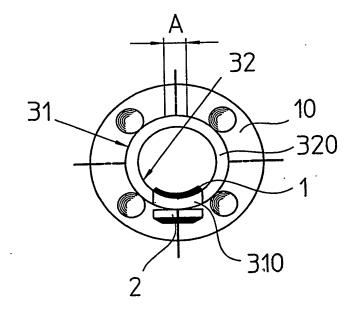
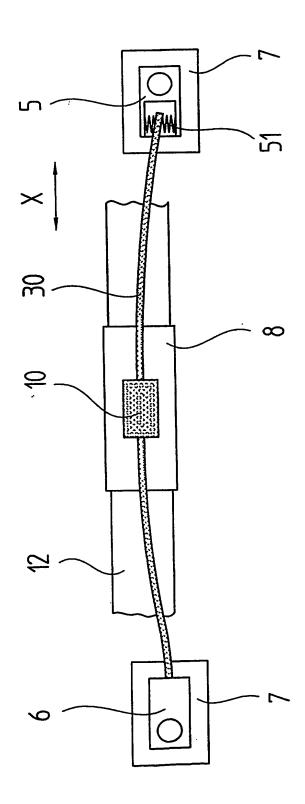


FIG. 8





F1G. 9

## **BEST AVAILABLE COPY**



International Silication No PCT/EP 03/06845

a. classif IPC 7	GO1D5/347 B23Q17/22 G01B3/00		
According to	International Palent Classification (IPC) or to both national classification	ion and IPC	
B. FIELDS			
	cumentation searched (classification system followed by classification $G01D - B23Q - G01B$	n symbols)	
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields sear	ched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, search terms used)	<del>_</del> -
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
Α	DE 199 14 311 A (HEIDENHAIN GMBH I JOHANNES) 5 October 2000 (2000-10- cited in the application claim 1		1–12
А	DE 197 00 367 A (ZEISS CARL JENA 16 July 1998 (1998-07-16) cited in the application claim 1	1-12	
А	DE 22 49 936 A (LUDWIGSBURGER MAS 18 April 1974 (1974-04-18) claim 1	CH BAU)	1-12
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	annex.
*T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but ded to understand the principle or theory underlying the livention state of particular relevance.  *E* earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the livention filing date or priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date do understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in conflict with the application but date of understand the principle or theory underlying the date of priority date and not in cannot be considered to expendence; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be cons		ne application but buy underlying the himmed invention so considered to urment is taken alone alone timed invention entive step when the eother such docues to a person skilled amily	
L	.5 October 2003 mailing address of the ISA	23/10/2003 Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018	De Gussem, J	

PCT/EP 03/06845

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 19914311	Α	05-10-2000	DE EP JP US	19914311 1041363 2000292101 6349481	A2 A	05-10-2000 04-10-2000 20-10-2000 26-02-2002
DE 19700367	Α	16-07-1998	DE US	19700367 6049992		16-07-1998 18-04-2000
DE 2249936	Α	18-04-1974	DE	2249936	A1	18-04-1974

BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONALER CHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/06845

a. klassif IPK 7	G01D5/347 B23Q17/22 G01B3/00		
	No. 1 - Data-Marael Braker (IDIO adau apah dar apilangka Masel	Filetion and der IDV	
	amationalen Patentiklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassif CHIERTE GEBIETE	ikaudi uid dei i-k	
	er Mindesiprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole G01D B23Q G01B	}	
Recherchiert	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowi	eit diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
Mishrond do	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nar	me der Datenbank und evil, verwendete S	uchbegriffe)
	cernal, WPI Data, PAJ		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 199 14 311 A (HEIDENHAIN GMBH D JOHANNES) 5. Oktober 2000 (2000-10 in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1	OR O-05)	1-12
А	DE 197 00 367 A (ZEISS CARL JENA ( 16. Juli 1998 (1998-07-16) 1n der Anmeldung erwähnt Anspruch 1	GМВН)	1-12
А	DE 22 49 936 A (LUDWIGSBURGER MASO 18. April 1974 (1974-04-18) Anspruch 1	CH BAU)	1–12
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber i "E" ätteres Anme "L" Veröffe schei ander soll o ausge "O" Veröffe eine I "P" Veröffe dem	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist .  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist .  entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie erührt) .  entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Tr Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich: Anmeldung nicht kollidiert, sondem nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedei kann allein aufgrund dieser Veröffentlicher inderischer Tätlokeit berühend beitre	worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf uchtet werden itung; die beanspruchte Erfindung weit berühend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 15. Oktober 2003	23/10/2003	and the state of t
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevolimächilgter Bediensteter  De Gussem, J	

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19914311	Α	05-10-2000	DE EP JP US	19914311 A 1041363 A 2000292101 A 6349481 B	2 04-10-2000 20-10-2000
DE 19700367	A	16-07-1998	DE US	19700367 A 6049992 A	
DE 2249936	Α	18-04-1974	DE	2249936 A	1 18-04-1974